

# بررسی عملکرد جذب خط انتقال ریزموج چاپ شده

## به روش جوهرافشانی در باند S

محمد مؤمنی نسب، سید منصور بیدکی، محسن هادی زاده و مسعود موحدی

صفحه رسانا و خط ریزنوواری هستند [۱] و [۲].

در روش مرسوم ساخت خطوط انتقال ریزموج و آتنن‌های ریزنوواری، خط انتقال یا آتنن [۳] تا [۷] از جنس فلز بوده و به صورت کاشه‌ی و با استفاده از فناوری لیتوگرافی نوری ساخته می‌شود که معمولاً گران و زمان بر بوده و دارای ضایعات شیمیایی است. یکی از روش‌های نوین برای ساخت خط انتقال ریزموج که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری بوده، روش چاپ جوهرافشان است. روش چاپ جوهرافشان، فرایندی افزایشی، غیر تتماسی، دارای دمای کاری پایین، سریع و سازگار با محیط است که نیازی به ماسک‌گذاری ندارد [۸]. این روش نوین چاپ برای ساخت مسیرهای رسانا و خطوط انتقال با استفاده از جوهر نانوذرات فلزی به ویژه نقره بر سطح زیرلایه‌های مختلف [۹] تا [۱۶] به کار رفته است.

تا کنون هیچ گزارشی درباره چاپ جوهرافشانی خطوط انتقال ریزموج با استفاده از جوهرهای واکنشی ارائه نشده است. جوهرهای واکنشی جوهرهایی هستند که پس از چاپ شدن توسط چاپگر جوهرافشان بر روی زیرلایه با یکدیگر واکنش داده و محصول مورد نظر را ایجاد می‌نمایند. جوهرهای واکنشی جهت ایجاد طرح‌های فلزی بر روی زیرلایه‌های مختلف با به کارگیری محلول‌های نمک فلزی و عامل کاهنده شیمیایی استفاده شده‌اند [۸] و [۱۷] تا [۱۹]. پس می‌توان خطوط انتقال ریزموج را با استفاده از جوهرهای واکنش دهنده تولید کرد. جوهرهای واکنش دهنده نسبت به جوهر نانوذرات نقره از برتری‌های مهمی چون هزینه کمتر، پایداری بالاتر، در دسترس بودن، امکان چاپ آنها با هدهای جوهرافشان معمولی (گرمایی)، قابلیت تنظیم خواص لایه فلزی تولیدی با تغییر تعداد دفعات چاپ جوهر و یا استفاده از جوهر با غلظت‌های متفاوت، برخوردار است. شایان یادآوری است که جوهر نانوذارت نقره می‌تواند اکسید شود و جهت جلوگیری از اکسایش نیاز به عملیات پایداری سطح زیرلایه دارد و همچنین جوهر نانوذرات نقره گران بوده و برای تولید انبوه مقرر به صرفه نیست [۲۰].

پژوهش حاضر نخستین تلاش برای معرفی جوهرهای واکنش دهنده به عنوان جایگزین کم‌هزینه و قابل اطمینان فلزات (از جمله مس) و جوهرهای حاوی نانوذرات نقره جهت تولید ساختارهای انتقال ریزموج و مسیرهای رسانا است. با به کارگیری جوهرهای واکنش دهنده بر پایه آب و روش چاپ جوهرافشان، خطوط انتقال ریزموج بر روی زیرلایه RO4003C چاپ شدن و همچنین اتصال فلز به ماده چاپی انجام گرفت. ساختار انتقال ریزموج تهیه شده بر پایه خط‌های ریزنوواری، نرخ جذب تقریباً ثابتی در گسترده فرکانس GHz ۲-۴ (باند S) را نشان داد.

### ۲- مواد و تجهیزات

در این پژوهش، از آسکوربیک اسید و نقره نیترات به ترتیب برای تهییه

چکیده: فناوری چاپ جوهرافشان یکی از نویدبخش‌ترین روش‌های چاپ است که ساخت الگوهای رسانا را در یک مرحله و به طور مستقیم امکان‌بدهی کرده است. در این پژوهش با به کارگیری جوهرهای واکنش دهنده بر پایه آب و روش چاپ جوهرافشان، خط انتقال ریزموج بر روی زیرلایه راجرز ۴۰۰۳C ساخته شد. ساختار انتقال ریزموج ساخته شده شامل خط نقره‌ای چاپ شده به روش جوهرافشان، لایه دی‌الکتریک و صفحه فلزی زمین است. میزان رسانایی خط چاپ شده به روش چهار الکترود تماشی اندازه‌گیری شد. نرخ جذب امواج الکترومغناطیسی خط انتقال چاپ شده با توجه به میزان رسانایی محاسبه شده، با نرم‌افزار شبیه‌ساز ساختارهای فرکانس بالا، شبیه‌سازی گردید که هم‌خوانی بسیار خوبی را با نرخ جذب اندازه‌گیری شده در گسترده فرکانس ۴-۲ GHz (باند S) دارد.

**کلیدواژه:** خط انتقال، چاپ جوهرافشان، جوهرهای واکنشی، نانو ذرات نقره، ریزموج.

### ۱- مقدمه

در یک سامانه الکترونیکی، انتقال توان نیازمند اتصال دو سیم میان منبع و مصرف‌کننده است. در فرکانس‌های پایین، توان خواسته شده از طریق سیم به مصرف‌کننده انتقال داده می‌شود اما در گسترده فرکانس ریزموج، توان خواسته شده در فرم میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی هست که از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر توسط برخی ساختارهای فیزیکی هدایت می‌شوند. هر ساختار فیزیکی که موج‌های الکترومغناطیسی را هدایت کند، خط انتقال نامیده می‌شود. در واقع خط انتقال، مداری با دو پورت (یک خروجی و یک ورودی) است که برای اتصال به مولد یا فرستنده سیگنال به مصرف‌کننده در یک فاصله معین استفاده می‌شود. خط‌های انتقال توزیع توان، در فرکانس‌های پایین و خط‌های انتقال امواج الکترومغناطیسی، در فرکانس‌های بالا به کار می‌روند. خطوط انتقال شامل کابل‌های هم‌محور، خط دو سیم، خط صفحات مسطح موازی، سیم بالای

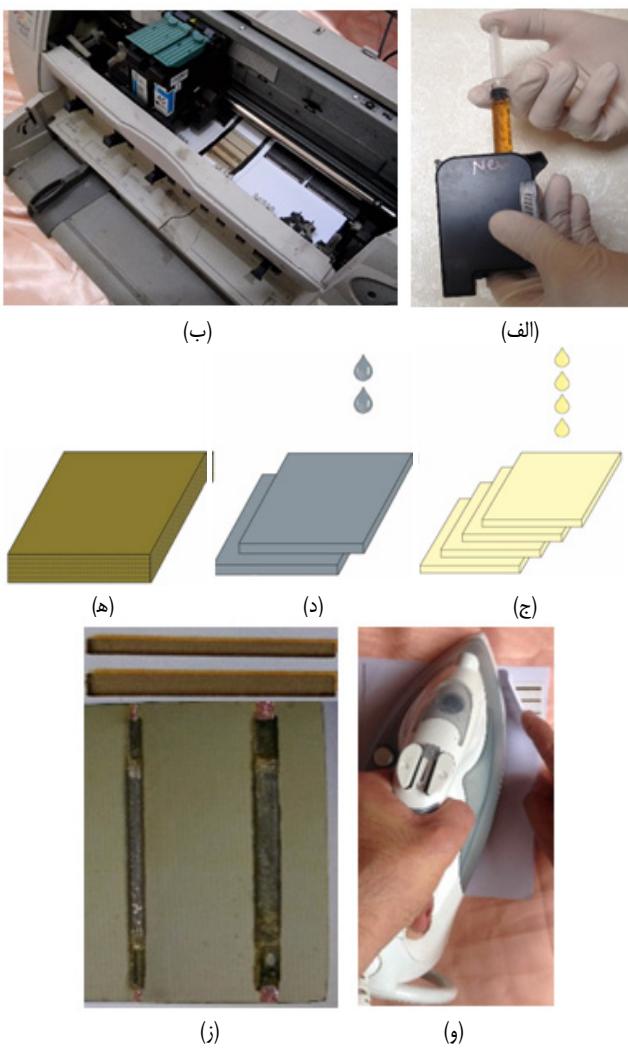
این مقاله در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دریافت و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بازنگری شد.

محمد مؤمنی نسب، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، (email: m.momeni78@gmail.com)

سید منصور بیدکی (نویسنده مسئول)، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، (email: smbidoki@yazd.ac.ir)

محسن هادی‌زاده، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران، (email: hadizadeh@yazd.ac.ir)

مسعود موحدی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد، یزد، ایران، (email: movahhedi@yazd.ac.ir)



شکل ۱: (الف) پُرکردن کارتريج چاپگر جوهراشان، (ب) قراردادن کارتريج حاوی جوهر آسکوربيک اسيد در چاپگر، (ج) چاپ جوهراشانی جوهر آسکوربيک اسيد، (د) چاپ جوهراشانی جوهر نقره نيترات، (ه) استحصال نانوذرات نقره در اثر واکنش عامل کاهنده با نمک فلزی، (و) حرارتدهی نانوذرات نقره استحصال يافته و (ز) طرح های نقره اى استحصال شده.

كه  $C_6H_5O_2^-$  محلول آسکوربيک اسيد (A)، محلول  $NaOH$  هيدروكسيد سديم،  $AgNO_3$  محلول نقره نيترات (G)،  $Ag(s)$  نقره استحصال يافته،  $C_6H_5O_2^-$  ده هيدرو آسکوربيک اسيد و  $NaNO_3$  سديم نيترات است.

ویژگی جوهرهای آماده شده در جدول ۲ قابل مشاهده هستند.

### ۲-۳ روش انجام آزمایشها

در فرایند چاپ جوهراشانی ساختار انتقال ريزموج، نخست جوهر محتوى کارتريج چاپگر جوهراشان تخلية گردید و درون کارتريج با آب مقطر شسته شد. به علت واکنش ميان دو محلول عامل کاهنده و نمک فلزی و جهت جلوگيری از گرفتگي نازل های ريز کارتريج، هر کدام از محلول ها يعني آسکوربيک اسيد و نقره نيترات در يك کارتريج جدا قرار گرفت (شکل ۱-الف) و در چاپ جوهراشانی طرح های الکتروني استفاده شدند [۱۷]. برای چاپ ساختار انتقال ريزموج ها، نخست کارتريج محظوظ شدند [۱۷]. برای چاپ داخل چاپگر قرار گرفت (شکل ۱-ب) و با توجه به تعداد مراحل چاپ بهينه A [۱۸] AAAAGGG نشانه چاپ يك مرحله کاهنده و G نشانه چاپ يك مرحله نمک فلزی است، چهار بار پي درپي محلول آسکوربيک اسيد چاپ شد (شکل ۱-ج) و در مرحله بعد کارتريج

جدول ۱: مشخصات دی الکترونیک زیرلایه RO<sub>40.03C</sub>.

نوع زیرلایه	ضخامت ( $\mu m$ )	ثابت دی الکترونیک	تاثر انت تلفات
صفحه راجز (RO <sub>40.03C</sub> )	۲۰.۳	۳.۵۵	[۲۲] ۰.۰۰۲۴

جدول ۲: ویژگی جوهرهای [۱۷].

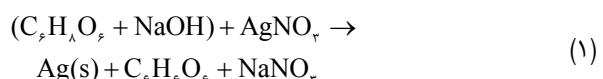
نوع جوهر	مواد جامد (%)	pH	چگالی ( $g/cm^3$ )
محلول آسکوربيک اسيد	۲۳	۵.۵	۱.۱۰
محلول نقره نيترات	۴۴	۳.۵	۱.۵۱

محلول های عامل کاهنده و نمک فلزی استفاده شد. محلول های آسکوربيک اسيد و نقره نيترات با به کارگيري آب مقطر، به ترتيب با غلظت های وزني ۳۰٪ و ۵۰٪ آماده شدند. برای انجام عمليات چاپ ساختار های انتقال ريزموج، راياني مجهز به نرم افزار Microsoft office Deskjet ۱۲۲۰C داراي وضوح تصوير ۶۰۰ dpi، یيشترین ضخامت زيرلایه قابل چاپ ۳۰۰  $\mu m$  و کارتريج مشکی ۴۵A بهره گرفته شد. صفحه راجز (RO<sub>40.03C</sub>) به عنوان زيرلایه برای چاپ خطوط انتقال ريزموج به کار رفت. جدول ۱ مشخصات دی الکترونیک زيرلایه RO<sub>40.03C</sub> را نشان مي دهد. جهت بررسی نرخ جذب امواج الکترومغناطيسی خط انتقال چاپ شده، دستگاه «تحليل گر شبکه برداری<sup>۱</sup> (VNA)» به کار رفت. برای اندازه گيري ميزان رسانايي خطوط چاپی از دستگاه «چهار الکترود تماسی<sup>۲</sup>»، منبع تغذيه DC ۰ مولتی متر استفاده شد. نرم افزار «شبیه ساز ساختار های فرکانس بالا (HFSS)<sup>۳</sup>» در شبیه سازی ها استفاده گردید. برای اندازه گيري پهنای خطوط چاپی از ميكروسكوب نوری استفاده شد. «ميكروسكوب الکترونی روبيشی - گسييل ميداني<sup>۴</sup> (FE-SEM)» جهت بررسی مورفولوژی لایه نقره اى تشکيل شده بر سطح زيرلایه به کار رفت.

### ۳- تجربيات

#### ۱-۳ آماده سازی جوهرهای

در فرایند چاپ، دو جوهر واکنش دهنده آسکوربيک اسيد و نقره نيترات به ترتيب به عنوان عامل کاهنده و نمک فلزی به کار رفتند تا از واکنش آن دو (رابطه (۱)) پس از چاپ شدن به صورت انفرادي و بيدريبي بر سطح زيرلایه، ذرات نقره فلزی استحصال شود. برای آماده سازی محلول های آسکوربيک اسيد و نقره نيترات به ترتيب با درصد های وزن به حجم (w/v) ۳۰٪ و ۵۰٪ از آب مقطر به عنوان حلال استفاده شد. غلظت های ياد شده بر پایه آزمایش و دستاورد پژوهشگر های پيشين با توجه به ميزان رسانايي بهينه ماده چاپی [۱۸] انتخاب شدند. محلول هيدروكسيد سديم (w/v ۳۵٪) برای انحلال بهتر آسکوربيک اسيد در آب و تنظيم pH محلول در ۵/۵ استفاده گردید. pH محلول نقره نيترات در مقدار اوليه اش ۳/۵ نگه داشته شد



1. Vector Network Analyzer

2. Four Point Probe

3. High Frequency Structure Simulator

4. Field Emission-Scanning Electron Microscopy

### ۳-۳ چاپ جوهرافشانی خط انتقال ریزموج بر روی زیرلایه راجرز

به منظور تهیه یک ساختار خطی انتقال دهنده ریزموج از جنس نانوذرات نقره‌ای استحصال شده به روش جوهرافشانی، یک خط با پهنای ۱/۷ mm و طول ۳۴ mm در نرم‌افزار word طراحی شد تا سپس در بین دو مستطیل کوچک که از قبل بر سطح صفحه مسی بالایی راجرز به روش انحلال انتخابی<sup>۱</sup> ایجاد شده بود مورد استحصال شیمیایی نقره قرار گیرد. دو مستطیل کوچک از جنس مس به پهنای ۱/۵ mm و طول ۸ mm بوده که نقش اتصال دهنده‌های دو طرف خط چاپی نقره‌ای به دستگاه‌های اندازه‌گیری را دارند. زیرلایه راجرز حاوی مستطیل‌های مسی با استفاده از چسب نواری به کاغذ A<sub>4</sub> چسبانده شد (شکل ۳-الف) و سپس الگوی طراحی شده با چاپ جوهرافشانی پی‌درپی محلول‌های آسکوربیک اسید و نقره نیترات از جنس نقره فلزی بر روی زیرلایه راجرز تهیه گردید (شکل ۳-ب).

### ۴- نتایج و بحث

#### ۴-۱ اندازه‌گیری میزان رسانایی الکتریکی خطوط چاپ شده بر روی زیرلایه راجرز

جهت بررسی میزان رسانایی الکتریکی خطوط چاپ شده بر روی زیرلایه راجرز، دستگاه «چهار الکترود تماسی»، منبع تغذیه مستقیم و دو مولتی‌متر طبق مدار شکل ۴-الف به یکدیگر متصل شدند که نمای الکتریکی مدار بسته شده در شکل ۴-ب قابل مشاهده است. در انجام این آزمون، ولتاژ و جریان الکتریکی منبع تغذیه به ترتیب روی ۷ و ۲۰۰ mA تنظیم شد.

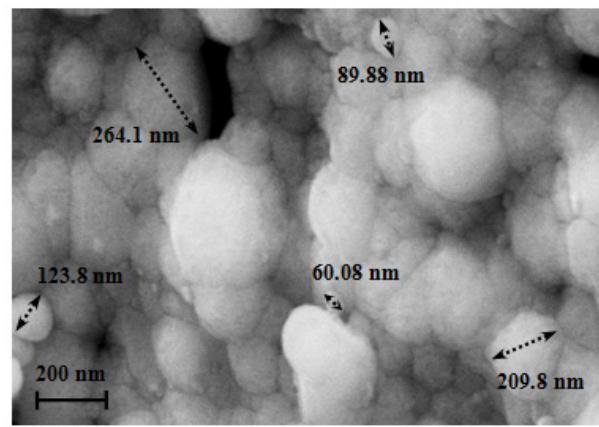
ابتدا دستگاه «چهار الکترود تماسی» روی خط چاپ شده نقره‌ای قرار گرفت و برای تماس بهتر با خط چاپی وزنهای با وزن ۵۰۰ g بر روی دستگاه «چهار الکترود تماسی» قرار داده شد. سپس عده‌های جریان و ولتاژ مولتی‌مترهای متصل به دو الکترود خارجی و دو الکترود داخلی دستگاه «چهار الکترود تماسی» خوانده شد و برای به دست آوردن میزان رسانایی خطوط چاپی از (۲۳) [۲۳] استفاده گردید.

$$\rho = R \frac{A}{l} \rightarrow \rho = R \frac{tw}{l} (\Omega m) \rightarrow$$

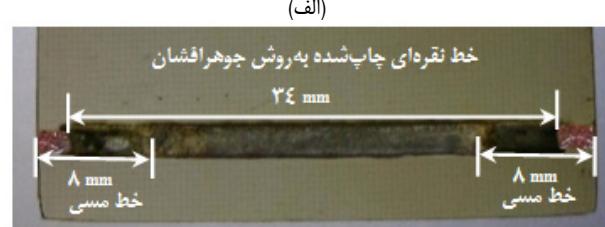
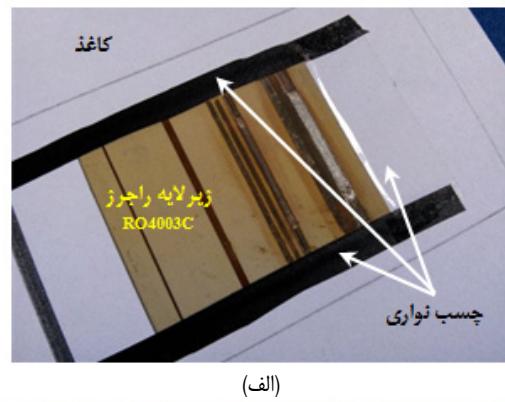
$$\sigma = \frac{l}{Rtw} = \frac{I}{Vtw} (S/m)$$
(۲)

در معادله یادشده،  $R$  مقاومت الکتریکی خط چاپی بر حسب  $\Omega$  (Ω)،  $\rho$  مقاومت ویژه خط چاپی بر حسب  $\Omega$  متر (Ωm)،  $l$  طولی از خط چاپ شده تحت آزمون رسانایی بر حسب متر (m)،  $A$  سطح مقطع خط چاپی بر حسب مترمربع (m<sup>2</sup>) که برابر است با  $t \times w$  (m<sup>2</sup>)،  $t$  ضخامت خط چاپی بر حسب متر (m)،  $w$  پهنای خط چاپی بر حسب متر (m)،  $V$  ولتاژ خوانده شده میان دو الکترود داخلی دستگاه «چهار الکترود تماسی» بر حسب ولت (V)،  $I$  شدت جریان عبوری از خط چاپی بر حسب آمپر (A) و  $\sigma$  رسانایی الکتریکی خط چاپی بر حسب یک بر  $\Omega$  متر (1/Ωm) یا زیمس بر متر (S/m) است.

در محاسبه میزان رسانایی خط چاپ شده (جدول ۳)،  $l$  طولی از خط چاپ شده که برابر با فاصله میان دو الکترود داخلی دستگاه «چهار الکترود

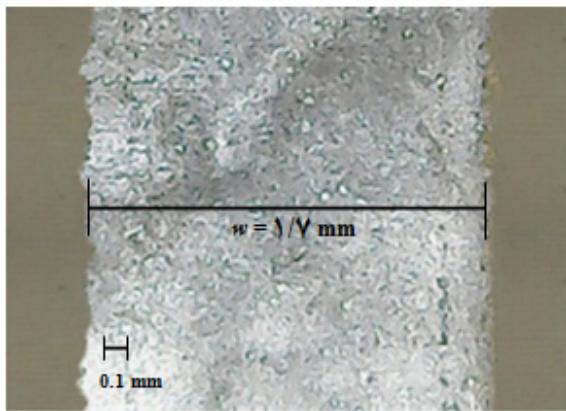


شکل ۲: تصویر میکروسکوپ الکترونی-گسیل میدانی (FE-SEM) نانوذرات نقره استحصال یافته بر زیرلایه پس از عملیات حرارتی.

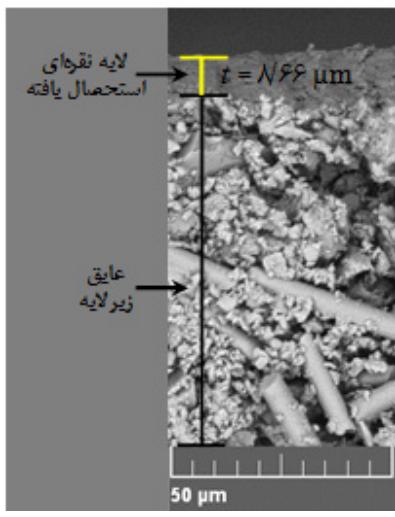


شکل ۳: (الف) ثابت کردن زیرلایه راجرز با چسب نواری به کاغذ و (ب) چاپ جوهرافشان خط انتقال ریزموج بر سطح زیرلایه راجرز.

محتوی نقره نیترات داخل چاپگر قرار گرفت و دو بار پی‌درپی محلول نقره نیترات چاپ گردید (شکل ۱-د). در هر مرحله از چاپ جوهرها (یعنی چهار بار محلول آسکوربیک اسید و دو بار محلول نقره نیترات) بستر مورد چاپ به گونه‌ای به چاپگر تغذیه شده است که جایه‌جایی آن به سمت عقب یا جلو و به سمت چپ یا راست تحت کنترل بوده است تا طرح دقیقاً در محل مشخص شده و با همپوشانی تقریباً کامل بر سطح چاپ شده قلی قرار گیرد. با این کار، محلول نقره نیترات با محلول آسکوربیک اسید واکنش داده و لایه‌ای از ذرات نقره بر سطح زیرلایه استحصال می‌گردد (شکل ۱-ه). به منظور افزایش میزان واکنش بین دو جوهر شیمیایی و تشکیل لایه‌ای یکدست از ذرات نقره، الگوهای چاپ شده در زیر یک پرس حرارتی با دمای ۲۰°C به مدت ۲۰ sec گرفتند (شکل ۱-و). شکل ۱-ز طرح‌های نقره‌ای استحصال شده نهایی به روش چاپ جوهرافشانی جوهرهای واکشنده شده را نشان می‌دهد. شکل ۲ تصویر میکروسکوپ الکترونی-گسیل میدانی نانوذرات نقره استحصال یافته به روش جوهرافشانی یادشده با قطر تقریبی ۶۰-۲۷۰ nm را نشان می‌دهد. در پایان، آزمون‌های ارزیابی ویژگی‌های الکتریکی دلخواه بر روی الگوهای چاپ شده انجام شد.

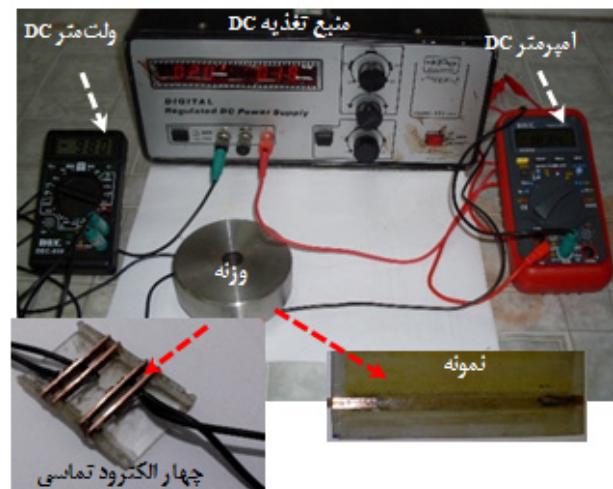


(الف)

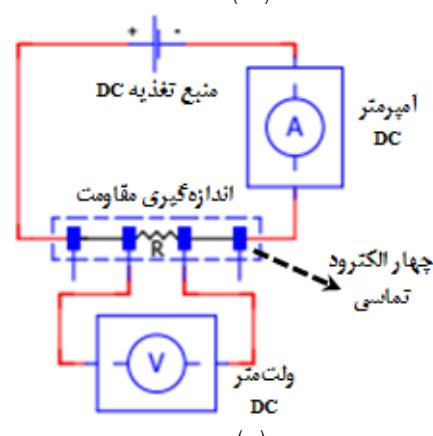


(ب)

شکل ۵: (الف) پهنهای خط چاپ شده (تصویر میکروسکوپ نوری) و (ب) ضخامت ماده چاپ شده (تصویر FE-SEM) بر روی صفحه راجرز.



(الف)



(ب)

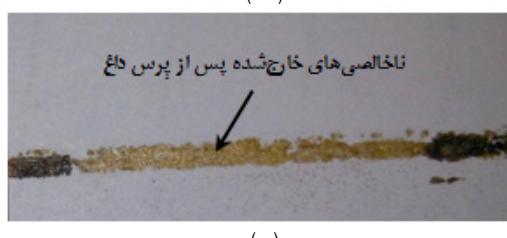
شکل ۶: (الف) تصویر اجزای مدار اندازه‌گیری میزان رسانایی خطاهای چاپ شده و ثابت کردن زیرلایه راجرز با چسب نواری به کاغذ و (ب) نمای الکتریکی مدار بسته شده جهت انجام آزمون رسانایی.

جدول ۳: میزان رسانایی خطاهای انتقال چاپ شده با پهنهای ۱/۷ MM ۱ بر روی زیرلایه راجرز.

ردیف	نام	فروزنده نیزه (S/E) برد	فروزنده کلکتریکی (Ω)	نیزه نیزه (mA)	نیزه نیزه (A)	نیزه نیزه (Ω)	نیزه نیزه (mm)	نیزه
۱	۳۰.۰۶	۲۶.۵	۵۷	۱.۵۱	۱.۶۹۳			
۲	۳۰.۴۱۳	۲۶.۸	۶۲	۱.۶۶	۱.۷۱۰			
۳	۲۹.۲۱۲	۲۸	۵۵	۱.۵۴	۱.۷۰۴			
۴	۲۹.۷۷۳	۲۷.۷	۵۳	۱.۴۷	۱.۶۹۰			
۵	۲۹.۶۸۷	۲۷.۶	۵۹	۱.۶۳	۱.۷۰۱			
میانگین	۳۰.۰۳۰	۲۷.۳۲	-	-	۱.۷۰۰			
CV%	۲.۴۰	۲.۳۴	-	-	۰.۴۸			



(الف)



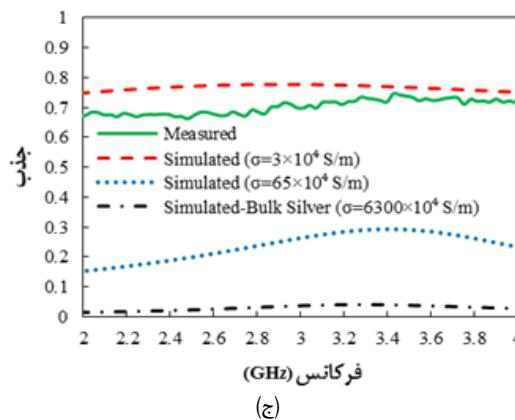
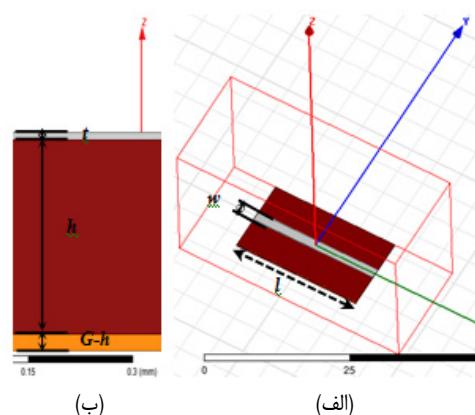
(ب)

شکل ۶: (الف) خط چاپی به روش جوهرا فشن و (ب) خارج شدن ناخالصی های ماده چاپی پس از آتونی داغ.

در ماده چاپی تحت حرارت و در تماس با یک لایه کاغذی فشرده شده بر سطح خطاهای چاپ شده تا اندازه ای خارج گردید (شکل ۶- ب) و رسانایی ماده چاپ شده افزایش یافت. دی‌هیدروآسکوربیک اسید و سدیم نیترات ناخالصی های خط چاپی یا فرآورده های فرعی واکنش اکسایش بین محلول های آسکوربیک اسید و نقره نیترات (فرمول ۱) هستند که هر دو در آب قابل حل بوده و از سطح ذرات استحصالی قابل شستشو می باشند [۱۸]. همچنین دی‌هیدروآسکوربیک اسید و سدیم نیترات بر اثر پرس داغ

تماسی» و مساوی  $11/15 \text{ mm}$  است و  $w$  پهنهای خطاهای چاپ شده که به وسیله میکروسکوپ نوری به دست آمده و به طور میانگین برابر  $1/7 \text{ mm}$  (شکل ۵- الف) است و  $t$  ضخامت لایه نقره ای تشکیل شده بر سطح زیرلایه به صورت خط چاپ شده است که به وسیله میکروسکوپ الکترونی- گسیل میدانی به دست آمده و به طور میانگین برابر  $8.66 \mu\text{m}$  (شکل ۵- ب) است.

خطاهای انتقال چاپ شده (شکل ۶- الف) دارای رسانایی الکتریکی پایینی بودند و جهت بهبود میزان رسانایی با به کار گیری اتوی پرسی تحت حرارت غیر مستقیم قرار گرفتند، به این روش ناخالصی های موجود



شکل ۷: تصویری از لحیم کاری اتصال دهنده هم محور به پشت و روی زیر لایه راجز.



شکل ۸: شبیه سازی خط انتقال چاپ شده در نرم افزار HFSS، (الف) نمای سه بعدی، (ب) نمای مقطع عرضی و (ج) نرخ جذب اندازه گیری و شبیه سازی.

در معادلات نامبرده،  $S_{11}$  ضریب بازتاب موج،  $(dB)$   $S_{11}$  ضریب انتقال موج،  $(\omega)$  نرخ جذب موج،  $(\omega)$   $R$  مقدار بازتاب موج و  $(\omega)$   $T$  مقدار انتقال موج است.

نرم افزار «شبیه ساز ساختارهای فرکانس بالا» جهت شبیه سازی خط انتقال چاپ شده به روش جوهرافشانی مورد استفاده قرار گرفت (شکل ۹-الف و ۹-ب). در شبیه سازی خط انتقال چاپ شده، پارامترهای میزان رسانایی اندازه گیری شده به روش DC  $(\sigma = 300 \times 10^4 S/m)$ ، پهنای خط چاپی ( $w = 1.7 mm$ )، طول خط چاپی ( $l = 24 mm$ )، ضخامت ماده چاپی ( $t = 8.66 \mu m$ )، مشخصات الکترو مغناطیس زیر لایه RO $4003C$  ( $h = 20.3 \mu m$ ) ( $\tan \delta = 0.0024$ ) و ضخامت عایق زیر لایه ( $h = 3.55 \mu m$ ) و ضخامت صفحه مسی زمین ( $G - h = 17.5 \mu m$ ) لحاظ شدند. شکل ۹-ج نمودارهای نرخ جذب اندازه گیری و شبیه سازی خط انتقال چاپ شده به روش جوهرافشانی در باند S (گستره فرکانس ۲-۴ GHz) را نشان می دهد. با توجه به شکل ۹-ج می توان ملاحظه کرد که هم محور بسیار خوبی میان نمودارهای نرخ جذب اندازه گیری و شبیه سازی شده (با میزان رسانایی  $\sigma = 3 \times 10^4 S/m$ ) وجود دارد به گونه ای که درصد خطا بین داده های شبیه سازی و اندازه گیری ۶٪ است.

با توجه به قابل تغییر بودن میزان هدایت الکتریکی لایه نقره ای تشکیل شده بر سطح زیر لایه، با تغییر تعداد دفعات و ترتیب چاپ جوهرافشانی جوهرهای واکنش دهنده بر سطح زیر لایه، بالاترین مقدار هدایت الکتریکی مشاهده شده از خط های نقره ای چاپ شده به روش جوهرافشانی بر زیر لایه های دیگر در نرم افزار شبیه سازی وارد شد تا اثر احتمالی افزایش هدایت الکتریکی لایه نقره ای بر رفتار جذب خط انتقال مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور نمودار شبیه سازی با میزان رسانایی استحصال بر لایه های کاغذی قرار گرفته بود در نرم افزار شبیه سازی وارد

غیر مستقیم با دمای  $200^{\circ}C$  و به مدت  $20 sec$ ، قابل کاستن هستند (شکل ۶-ب).

میزان رسانایی خط های انتقال چاپ شده بر روی زیر لایه راجز پس از حرارت دهی به طور میانگین  $300 \times 10^4 S/m$  به دست آمد (جدول ۳).

#### ۴-۲ بررسی نرخ جذب خط انتقال چاپ شده به روش جوهرافشانی

به منظور اندازه گیری نرخ جذب خط انتقال ریزموچ، «اتصال دهنده های هم محور» به مستطیل های مسی و صفحه زمین لحیم کاری شدند (شکل ۷).

شکل ۸-الف تابش موج به خط انتقال چاپ شده به وسیله دستگاه «تحلیل گر شبکه بُرداری» را نشان می دهد که نمونه ای از پارامتر  $S$  ( $dB$ ) اندازه گیری شده در شکل ۸-ب قابل مشاهده است.

با توجه به نمودارهای ضریب بازتاب موج ( $S_{11}$ ) ( $dB$ ) و ضریب انتقال موج ( $S_{21}$ ) ( $dB$ ) استخراج شده از دستگاه تحلیل گر شبکه بُرداری و  $S$  ( $dB$ ) به اندازه یا بزرگی  $^2$  تبدیل شدن و با به کار گیری (۴)، میزان اتلاف موج در خط انتقال چاپ شده محاسبه شد

$$20 \log_{10} |S| = S(dB) \rightarrow |S| = 10^{(S(dB)/2)} \quad (3)$$

$$A(\omega) = 1 - R(\omega) - T(\omega) = 1 - |S_{11}|^2 - |S_{21}|^2 \quad (4)$$

1. SMA Connector
2. Magnitude

- IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, vol. 5, no. 12, pp. 178-181, Feb. 2013.
- [۷] ع. حیدری، " طراحی و ساخت آنتن ریزنوواری با پلاریزاسیون دایره‌ای با قابلیت بهبود SWR وردی برای کاربرد GPS". نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، سال ۵ شماره ۳، پاییز ۱۳۸۶.
- [۸] S. M. Bidoki, D. McGorman, D. M. Lewis, M. Clark, G. Horler, and R. E. Miles, "Inkjet printing of conductive patterns on textile fabrics," *AATCC Review*, vol. 5, no. 6, pp. 11-14, Jun. 2005.
- [۹] H. L. Kao, C. H. Chuang, L. C. Chang, C. L. Cho, and H. C. Chiu, "Inkjet-printed silver films on textiles for wearable electronics applications," *Surface and Coatings Technology*, vol. 362, no. 4, pp. 328-332, Mar. 2019.
- [۱۰] B. Huber, J. Schober, M. Kaiser, A. Ruediger, and C. Schindler, "Rotate-to-bend setup for fatigue bending tests on inkjet-printed silver lines," *Flexible and Printed Electronics*, vol. 3, no. 3, Article No. 035005, 7 pp., Aug. 2018.
- [۱۱] S. M. Sim, *et al.*, "RF performance of ink-jet printed microstrip lines on rigid and flexible substrates," *Microelectronic Engineering*, vol. 168, no. 1, pp. 82-88, Jan. 2017.
- [۱۲] S. M. Sim, Y. Lee, H. L. Kang, K. Y. Shin, S. H. Lee, and J. M. Kim, "Transmission line printed using silver nanoparticle ink on FR-4 and polyimide substrates," *Micro and Nano Systems Letters*, vol. 4, no. 1, pp. 1-6, Dec. 2016.
- [۱۳] J. Wang, S. Lam, and E. G. Lim, "RF performance evaluation of microstrip lines printed on flexible polyethylene terephthalate (PET) films," in *Proc. IEEE MTT-S Int. Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications, IMWS-AMP'15*, vol. 3 pp., Suzhou, China, 1-3 Jul. 2015.
- [۱۴] F. Mohtaram, V. Mottaghitalab, G. Baghersalimi, and A. K. Hagh, "The development of textile based microstrip antenna using inkjet printing," *J. of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal)*, vol. 33, no. 3, pp. 61-78, Mar. 2015.
- [۱۵] V. Camarchia, *et al.*, "Demonstration of inkjet-printed silver nanoparticle microstrip lines on alumina for RF power modules," *Organic Electronics*, vol. 15, no. 1, pp. 91-98, Jan. 2014.
- [۱۶] M. M. Belhaj, *et al.*, "Inkjet printed flexible transmission lines for high frequency applications up to 67 GHz," in *Proc. 44th European Microwave Conf.*, pp. 1528-1531, Rome, Italy, 6-7 Oct. 2014.
- [۱۷] M. Momeni Nasab, S. M. Bidoki, and A. A. Heidari, "Inkjet-fabricated capacitors on paper and textile fabrics," *J. of Textiles and Polymers*, vol. 7, no. 1, pp. 45-52, Jan. 2019.
- [۱۸] S. M. Bidoki, J. Nouri, and A. A. Heidari, "Inkjet deposited circuit components," *J. of Micromechanics and Microengineering*, vol. 20, no. 5, Article No. 055023, 7 pp., Apr. 2010.
- [۱۹] S. M. Bidoki, D. M. Lewis, M. Clark, A. Vakorov, P. A. Millner, and D. McGorman, "Ink-jet fabrication of electronic components," *J. of Micromechanics and Microengineering*, vol. 17, no. 5, pp. 967-974, Apr. 2007.
- [۲۰] G. Singh, H. Sheokand, K. Chaudhary, K. V. Srivastava, J. Ramkumar, and S. A. Ramakrishna, "Fabrication of a non-wettable wearable textile-based metamaterial microwave absorber," *J. of Physics D: Applied Physics*, vol. 52, no. 38, Article No. 385304, 14 pp., Jul. 2019.
- [۲۱] -, *Simulator High Frequency Structure*, Ansoft Corp., Pittsburgh, PA, USA, 2012.
- [۲۲] -, *Sheet Rogers RO4003 Laminates Data*, Rogers Corp., Chandler, AZ, USA, 2018.
- [۲۳] J. G. Webster, *Electrical Measurement, Signal Processing, and Displays*, CRC Press, Jul. 2003.

محمد مؤمنی نسب تحقیلات خود را در مقاطعه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی نساجی به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۹ از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه یزد به پایان رسانده است. ایشان تحقیقات خود را در مقاطعه دکترای مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی نساجی از سال ۱۳۹۲ در دانشگاه یزد آغاز نمود. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان شامل چاپ اجزای مدارهای الکتریکی و جاذبهای امواج الکترومغناطیسی به روش جوهراشانی و منسوجات هوشمند است.

سید منصور پیدکی تحقیلات خود را در مقاطعه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۵ در دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایان رسانده است. ایشان در سال ۱۳۸۶ موفق به اخذ درجه دکترا در رشته مهندسی شیمی رنگ و پلیمر از دانشگاه لیدز انگلستان گردید. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان شامل چاپ و رنگرزی، شیمی پلیمر، نانوتکنولوژی، منسوجات هوشمند و الکترونیک چاپی است.

شد که کاهش میزان جذب امواج الکترومغناطیسی به وسیله خط انتقال در باند S را به دنبال داشت. همان‌گونه که از شکل ۹-ج مشخص است با نزدیکتر شدن میزان رسانایی خطهای انتقال تهیه شده به روش جوهراشانی به میزان رسانایی نقره خالص، میزان جذب موج، کاهش بسیار زیادی داشته است. نظر به وجود امکان افزایش هدایت لایه تهیه شده نقره‌ای به روش جوهراشانی می‌توان انتظار داشت تا روش چاپ جوهراشان با جوهرهای واکنشی امکان ساخت خطهای انتقال با مقادیر جذب موج قابل قبول را به شیوه‌ای ساده و سریع ممکن سازد.

## ۵- نتیجه‌گیری

روش چاپ جوهراشانی در مقایسه با روش‌های مرسوم ساخت هادی‌ها روشی سریع، کاربرپسند، مقومنه صرفه و سازگار با محیط است. در این پژوهش، با استحصال شیمیابی نقره به روش جوهراشانی بر روی زیرلايه RO<sub>4003C</sub> خط انتقال ریزموچ به طور موقیت‌آمیزی ساخته شد. ذرات فلزی نقره در اندازه‌های نانومتری از واکنش جوهرهای واکنش دهنده حاوی محلول آبی عامل کاهنده ( محلول آسکوربیک اسید) و نمک فلزی ( محلول نقره نیترات) بر سطح زیرلايه استحصال یافتند. جوهرهای واکنش دهنده بر پایه آب به عنوان جایگزین کم‌هزینه و قابل اطمینان جوهرهای حاوی نانوذرات نقره و دیگر فلزات جهت تولید ساخته‌های انتقال ریزموچ برای نخستین بار معرفی شد. نتایج اندازه‌گیری نشان می‌دهند که نرخ جذب خط انتقال چاپ شده در باند S (گستره فرکانس ۲-۴ GHz) تقریباً ثابت بوده و از هم‌خوانی بسیار خوبی با نتایج حاصل از شبیه‌سازی نرم‌افزاری برخوردار است. این هم‌خوانی نرخ جذب، بیانگر صحت اندازه‌گیری میزان رسانایی به دست آمده به روش چهار الکترود تماسی (روش DC) و استفاده آن در شبیه‌سازی ساخته‌های فرکانس بالاست. افزایش میزان هدایت الکتریکی لایه چاپ شده نقره‌ای می‌تواند باعث کاهش میزان تلفات جذبی موج منتقل شده از خط انتقال شود. در پژوهش‌های آینده، هدف، بهبود میزان رسانایی ماده چاپی و کاهش میزان اتلاف موج انتقالی در باند ریزموچ‌هاست.

## ۶- سپاس گزاری

از پژوهشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد برای پشتیبانی مالی از این پژوهش، قدردانی می‌شود.

## مراجع

- [۱] -, *Microwave Engineering-Transmission Lines*, 2020, (available on [https://www.tutorialspoint.com/microwave\\_engineering/microwave\\_engineering\\_transmission\\_lines.htm](https://www.tutorialspoint.com/microwave_engineering/microwave_engineering_transmission_lines.htm)).
- [۲] -, *Transmission Line Theory*, 2020, (available on <http://deltauniv.edu.eg/new/engineering/wp-content/uploads/chap.3.pdf>).
- [۳] K. Ramezani-Boldaji, M. Movahhedi, and A. Ghafoorzade-Yazdi, "An ultra wide bandpass filter with wide stop band based on metamaterial structures," *Tabriz J. of Electrical Engineering*, vol. 49, no. 1, pp. 191-199, Apr. 2019.
- [۴] F. Fesharaki, T. Djerafi, M. Chaker, and K. Wu, "Mode-selective transmission line for DC-to-THz super-broadband operation," in *Proc. IEEE MTT-S Int. Microwave Symp., IMS'16*, 4 pp., San Francisco, CA, USA, 22-27 May 2016.
- [۵] M. Alibakhshi-Kenari, M. Naser-Moghadasi, B. S. Virdee, A. Andujar, and J. Anguera, "Compact antenna based on a composite right/left-handed transmission line," *Microwave and Optical Technology Letters*, vol. 57, no. 8, pp. 1785-1788, Aug. 2015.
- [۶] J. Naqui, M. Duran-Sindreu, and F. Martin, "Modeling split-ring resonator (SRR) and complementary split-ring resonator (CSRR) loaded transmission lines exhibiting cross-polarization effects,"

مسعود موحدی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات در سال ۱۳۷۷ در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رسانده است. ایشان تحصیلات خود را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق گرایش مخابرات میدان به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایان رسانده است. زمینه‌های تحقیقاتی مورد تحقیقاتی مورد علاقه ایشان شامل روش‌های عددی در الکترومغناطیس، آتنن‌ها و مدارهای غیر فعال مایکروویو و فراماده‌ها است.

محسن هادیزاده تحصیلات خود را در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی نساجی به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۷ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایان رسانده است. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان شامل خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه، کنترل کیفیت، مدل‌سازی و روش‌های هوش مصنوعی و مهندسی بافت است.